

平成26年度

明石高専 技術講演会

参加費無料

日時 平成26年9月25日(木) 15:00~16:30 (14:30 開場)

会場 明石市立産業交流センター 4階研修室
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7 (JR大久保駅下車 南口から西へ徒歩2分。有料駐車場あり)

講演 「半導体材料の微弱な吸収の評価法
— 薄膜太陽電池材料の光学的特性を評価する光熱変換法 —」
明石高専 電気情報工学科 教授 堤 保雄氏

現在、薄膜太陽電池材料としてアモルファス Si やCdTe が商業生産され、CuInSe₂ が商業生産準備中です。これら薄膜太陽電池材料の評価方法の一つに光熱変換法〔光熱偏向分光法 (PDS) や光音響分光法 (PAS) 〕があります。

この方法の特長は、半導体材料を非破壊で評価でき、 10^3cm^{-1} 以下の低吸収係数の試料でも測定が可能です。この方法を用いてアモルファス Si を中心に薄膜太陽電池材料を評価してきたので、その原理と評価法を解説するとともに、最近の薄膜太陽電池の現状を紹介します。

定員 30名 (先着順)

申込先 問合せ FAXまたは 電話にて下記までお申し込みください。
(氏名、企業名、所属・役職、連絡先を明記)

明石市産業振興財団 企業支援係
TEL 078-936-7917 FAX 078-936-7916

※ ホームページ <http://www.aicc.or.jp> からもお申込みいただけます。

主催 明石工業高等専門学校 一般財団法人明石市産業振興財団

明石市産業振興財団行 < 9/25 技術講演会参加申込書 >
(FAX 078-936-7916)

氏名	TEL		FAX	
	E-mail			
社名	(部署)			
住所				

※ ご記入いただいた個人情報等については、本財団が実施する各種事業の企画、案内、情報提供に利用することがあります。
なお、特に参加証の発行や受付等のご連絡はいたしません。